

두께측정기술 반사광과 간섭광을 이용한 다층막 구조물의 두께와 형상 측정장치 및 측정방법

특허등록번호

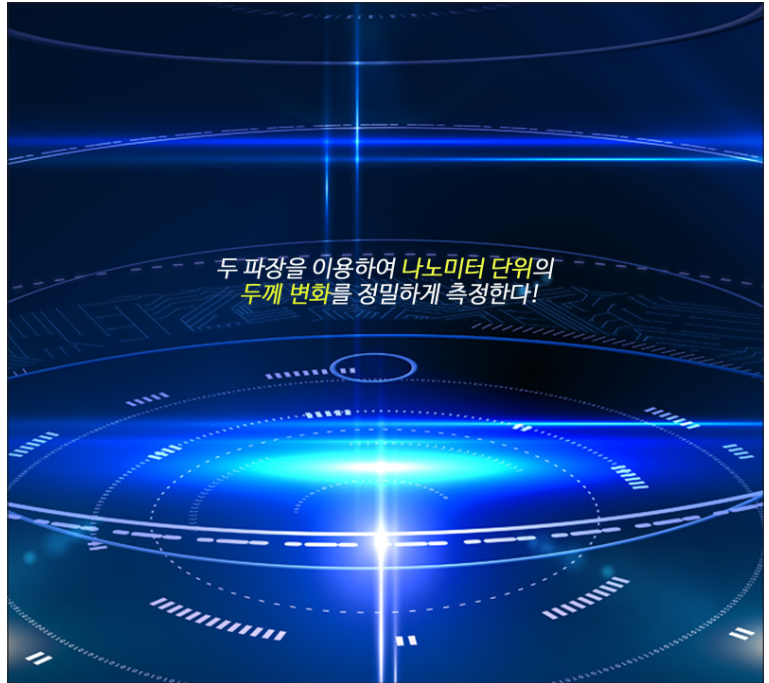
출원번호 10-2016-0075238

특허명

반사광과 간섭광을 이용한 다층막 구조물의 두께와 형상 측정장치 및 측정 방법

대표발명자

우주광학센터 김영식



간섭신호로부터 두께 정보를 보다 쉽고 빠르게 그리고 정확하게 얻어내는 기술



수십 나노미터(nm)에 이르는 매우 미세한 물질의 두께 변화를 측정해내는 KRISS의 '두께 측정 장치' 기술을 소개합니다. 생산 공정에 쓰이는 대형 유리, 웨이퍼, 필름 등의 물질의 두께를 측정할 때 꼭 필요한 측정 및 검사기술이랍니다.

특히 이 기술은 간섭신호로부터 두께 정보를 보다 쉽고 빠르게 그리고 정확하게 얻어내며 진동 환경에서 적용이 가능한지의 여부까지 검사하기 때문에 플렉서블 디스플레이, LCD디스플레이, 반도체 등의 산업에서 두께 검사 장비로 활용할 수 있습니다.